

KH5665

多通道晶体高激励机



KH5665 多通道晶体高激励机设计為支援载盘式微调机，如 KH2200 系统，提供贴片晶体的高激励操作需求。

系统为单轴运行，能支援 15 列 8mm 隔距和 16 列 7mm 隔距的双载盘设计。载盘容量可供选择和储存。

KH5665 系统采用 EIA-512 的测量模式处理高激励的驱动要求，还能提供基本的晶体参数，如 F_s , FL , R_s , C_0 , C_1 , L_1 , Q , T_s , DLD 等等。因本系统主要为提供高激励清洗的為目的，参数的测量结果只为参考数据，不建议作为标准数据。

系统还提供生产批次报告，以便生产的质量管理。



科研精密科技有限公司 科研集团

总部：香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话：(852) 35112388 传真：(852) 35112300

研创自动化设备（惠州）有限公司

广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901
Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>

规格

- 频率范围 : 5 - 120 MHz
- 等效高激励功率 : ~500mW (最高) @ 25 ohm.
- 电路模式 : EIA512
- 可选激励时间 : 0.1 秒 ~ 45 秒(最高) (每只)
- 参考参数 : Fs, Fr, FL, Rs, Rr, RL, CL, C0, C1, L1, Q, Ts, C0/C1, DLD...
(测试结果为参考数据, 不为标准数据)
** 用户可跟据晶体规格设立参数结果的比较设定
- 簡易的系统操作, 包括使用菜单校准操作等
- 中文简体(GB)操作软件
- 校准方法 : 短路 / 负载 / 开路
- 工业电脑(或等同) 带 XP 视窗
- 需压缩气运作
- 尺寸 : 540(W) x 820(D) x 1600(H) (不连指示灯座)



以上為操作軟件主視窗, 以作參考

选项

- 可特制不同间距尺寸之测试头 (可联络业务部)

规格如有更改, 恕不另行通知。
显示的照片仅供参考。

Windows 是 Microsoft Corp. 的注册商标。



科研精密科技有限公司 科研集团

总部: 香港荃湾荃湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话: (852) 35112388 传真: (852) 35112300

研创自动化设备(惠州)有限公司

广东省惠州市惠城区高新科技园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901
Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>